

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 18 年 3 月 30 日 (2006.3.30)

【公表番号】特表 2006-504229 (P2006-504229A)
 【公表日】平成 18 年 2 月 2 日 (2006.2.2)
 【年通号数】公開・登録公報 2006-005
 【出願番号】特願 2003-582849 (P2003-582849)
 【国際特許分類】

H 0 1 M 8/02 (2006.01)

H 0 1 M 8/10 (2006.01)

H 0 1 M 8/12 (2006.01)

【F I】

H 0 1 M 8/02 E

H 0 1 M 8/10

H 0 1 M 8/12

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 2 月 10 日 (2006.2.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

取付具アセンブリから膜電極アセンブリ (M E A) を、該取付具アセンブリ内での M E A 接合の後に分離する方法であって、該取付具アセンブリが、該 M E A の第 1 表面に接触する第 1 取付具と該 M E A の第 2 表面に接触する第 2 取付具とを備え、該第 1 および第 2 取付具がそれぞれ実質的多孔性領域を備えてなる、方法において、

前記取付具アセンブリの前記第 1 取付具を安定化するステップと、

前記取付具アセンブリの前記第 2 取付具を安定化するステップと、

前記第 2 取付具が安定化される間に、前記第 1 取付具を加圧して、前記 M E A の前記第 1 表面を前記第 1 取付具から分離させるステップと、

前記第 1 取付具が安定化される間に、前記第 2 取付具を加圧して、前記 M E A の前記第 2 表面を前記第 2 取付具から分離させるステップと、

前記第 1 取付具の近傍から前記第 2 取付具を移動させて、前記第 1 取付具からの前記 M E A の取出しを可能にするステップと、
 を具備することを特徴とする方法。

【請求項 2】

前記第 1 取付具と前記 M E A の前記第 1 表面とに圧力が加えられている間に、前記第 2 取付具と前記 M E A の前記第 2 表面とに真空を与え、続いて、前記第 2 取付具と前記 M E A の前記第 2 表面とに圧力が加えられている間に、前記第 1 取付具と前記 M E A の前記第 1 表面とに真空を与え、

前記第 1 取付具を安定化するステップは、前記第 1 取付具をつかんで該第 1 取付具を安定させることを含み、

前記第 2 取付具を安定化するステップは、真空を用いて前記第 2 取付具を安定させることを含む、

請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

取付具アセンブリから膜電極アセンブリ（MEA）を、該取付具アセンブリ内でのMEA接合の後に分離する装置であって、該取付具アセンブリが、該MEAの第1表面に接触する第1取付具と該MEAの第2表面に接触する第2取付具とを備え、該第1および第2取付具がそれぞれ実質的多孔性領域を備えてなる、装置において、

第1ポートを有するベースであって、該第1ポートが前記第1取付具の前記多孔性領域を介して前記MEAの前記第1表面と流体連通するように、前記取付具アセンブリを受容するベースと、

支持体上に移動可能に取付けられるグリッパアセンブリであって、グリッパ機構と第2ポートとを有し、該第2ポートが、前記第2取付具の前記多孔性領域を介して前記MEAの前記第2表面と流体連通するグリッパアセンブリと、を具備し、

前記第1および第2ポートが、選択的に加圧かつ排気されて、それぞれ前記第1および第2取付具から前記MEAの前記第1および第2表面を分離し、

前記グリッパアセンブリが、前記第2取付具の一对の両縁を解放可能につかんで、前記第1取付具の近傍から前記第2取付具を移動させるようになっていること、を特徴とする装置。